

お客様各位

「第2回 AM シンポジウム」 協賛出展のご案内

拝啓、貴社ますますご盛栄のこととお慶び申し上げます。

平素は弊社の光造形事業に格別の御高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、弊社は来る2012年1月25日（水）東京大学生産技術研究所において開催されます「第2回 AM シンポジウム」に協賛し、併設展示場に出展致します。

積層造形技術（Additive Manufacturing Technologies）研究発表とともに弊社からの最新情報をご覧頂きたくここにご案内申し上げます。

参加費用は無料（懇親会参加費用は有料）ですので、関係者の方々をお誘い合わせの上、御来場賜りますよう心よりお待ちしております。

【弊社の展示内容】

- I, 耐熱透明 新アンチモンフリー樹脂の紹介
- II, クラッシュフォーム™CMET精密鋳造法の紹介

【AM シンポジウム詳細】

開催日時	2012年1月25日（水） 10:00~17:30 （受付9:30~）
開催場所	東京大学生産技術研究所 コンベンションホール 東京都目黒区駒場4-6-1 生産技術研究所アクセス： http://www.iis.u-tokyo.ac.jp/access/access.html
申込方法	http://niinolab.iis.u-tokyo.ac.jp/am_symposium2012.html 上記 HP をご確認くださいの上、各自お申込み下さい。

【第1回シンポジウムの様子】



【問い合わせ先】

シーメット株式会社 営業部長 荒井 誠 TEL：045-478-5561